

NIMS解析・評価共用設備 利用料金表 (ARIM利用：データ提供あり)

税抜表示 1時間あたり (円)

設備ID	装置名	課金単位	大学・公的機関・スタートアップ企業					中小企業					大企業				
			機器利用	技術補助	技術代行1	技術代行2	技術代行3	機器利用	技術補助	技術代行1	技術代行2	技術代行3	機器利用	技術補助	技術代行1	技術代行2	技術代行3
NM-001	NMR	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-002	LC-MS(Q-Exactive Plus)	Hour(1h)	2,200	3,800	5,400			4,400	7,600	10,800			6,600	11,400	16,200		
NM-020	LC-MS(Orbitrap Exploris 480)	Hour(1h)	3,300	4,900	6,500			6,600	9,800	13,000			9,900	14,700	19,500		
NM-003	ラマン顕微鏡	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-004	共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-005	液中原子間力顕微鏡	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-006	卓上走査型電子顕微鏡装置群	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-007	表面プラズモン共鳴装置	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-008	プレートリーダー	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-009	分光光度計	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-010	分光蛍光光度計	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-011	フーリエ変換赤外分光光度計	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-012	円二色性分散計	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-013	ゼータ電位計	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-014	動的光散乱光度計	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-015	粒度分布測定装置	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-016	接触角計	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-017	テクスチャーアナライザー	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-018	HPLC(質量分析計付き)	Hour(1h)	2,200	3,800	5,400			4,400	7,600	10,800			6,600	11,400	16,200		
NM-019	ゲル浸透クロマトグラフィー装置群	Hour(1h)	1,100	2,700	4,300			2,200	5,400	8,600			3,300	8,100	12,900		
NM-101	500MHz固体汎用NMRシステム (JNM-ECZ500R)	Day(8h)	1,100	2,700	2,860	4,300		2,200	5,400	5,720	8,600		3,300	8,100	8,580	12,900	
NM-102	500MHz固体高分解能NMRシステム (JNM-ECZ500R)	Day(8h)	1,100	2,700	2,860	4,300		2,200	5,400	5,720	8,600		3,300	8,100	8,580	12,900	
NM-103	800MHzナローボア固体高分解能NMRシステム (JNM-ECA800)	Day(8h)	1,100	2,700	2,860	4,300		2,200	5,400	5,720	8,600		3,300	8,100	8,580	12,900	
NM-201	多環境対応型X線単結晶構造解析装置 (XtaLAB Synergy-R/DW Custom)	Hour(1h)	2,200	3,800	3,960	5,400	7,000	4,400	7,600	7,920	10,800	14,000	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000
NM-209	2波長Pilatus低温単結晶X線回折装置 NSC (VariMax DW AFC11 with Pilatus)	Hour(1h)	2,200	3,800	3,960	5,400	7,000	4,400	7,600	7,920	10,800	14,000	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000
NM-204	多目的X線回折装置 Cu_SSL (SmartLab 9 kW)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-210	温度可変型粉末X線回折装置 Cu1 NTS (SmartLab 9 kW with cryostat/furnace)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-211	高速・高感度型粉末X線回折装置 Cu_ASC_NS3 (SmartLab3)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-212	卓上型粉末回折計 Cu_ASC_NC1 (MiniFlex600_Cu)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-213	卓上型粉末回折計 Cu_ASC_NC2 (MiniFlex600_Cu)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-214	卓上型粉末回折計 Cr_SCR (MiniFlex600_Cr)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-215	卓上型X線回折計 Cu_SMF (MiniFlex600_Cu)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-216	薄膜X線回折装置 Cu(SmartLab)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-202	硬X線電子分光分析装置(HAX-PES/XPS) (Quantes)	Hour(1h)	2,200	3,800				4,400	7,600				6,600	11,400			
NM-225	X線電子分光分析装置(XPS-Quantera SXM)	Hour(1h)	2,200	3,800				4,400	7,600				6,600	11,400			
NM-203	誘導結合プラズマ発光分析装置群	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-205	飛行時間型二次イオン質量分析装置 (PHI TRIFT V nanoTOF)	Hour(1h)	3,300	4,900				6,600	9,800				9,900	14,700			
NM-206	酸素窒素水素分析装置(OH836) 炭素硫黄分析装置(CS844)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-217	熱分析装置(TG/DTA+DSC) (TG/DTA 6200, X-DSC7000)	Hour(1h)	1,100	2,700				2,200	5,400				3,300	8,100			
NM-218	ゼータ電位&粒径測定装置(ELSZ-2000ZS)	Hour(1h)	1,100	2,700				2,200	5,400				3,300	8,100			
NM-219	フーリエ変換赤外分光光度計(IRAffinity-1S)	Hour(1h)	1,100	2,700				2,200	5,400				3,300	8,100			
NM-220	紫外可視近赤外分光計(V-770)	Hour(1h)	1,100	2,700				2,200	5,400				3,300	8,100			
NM-221	分光蛍光光度計(FP-8500DS)	Hour(1h)	1,100	2,700				2,200	5,400				3,300	8,100			
NM-222	蛍光分光計(Fluorolog-3)	Hour(1h)	1,100	2,700				2,200	5,400				3,300	8,100			
NM-223	フーリエ変換赤外分光計(FT/IR-6700)	Hour(1h)	1,100	2,700				2,200	5,400				3,300	8,100			
NM-224	中低温示差熱分析装置(DSC200F3)	Hour(1h)	1,100	2,700				2,200	5,400				3,300	8,100			
NM-207	電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置(JXA-8500F)	Hour(1h)	2,200	3,800	3,960	5,400	7,000	4,400	7,600	7,920	10,800	14,000	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000
NM-208	走査型オージェ電子分光分析装置 (JAMP-9500F)	Hour(1h)	2,200	3,800	3,960	5,400	7,000	4,400	7,600	7,920	10,800	14,000	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000
NM-226	ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡(JSM-7001F)	Hour(1h)	2,200	3,800	3,960	5,400	7,000	4,400	7,600	7,920	10,800	14,000	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000
NM-227	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8000)	Hour(1h)	2,200	3,800	3,960	5,400	7,000	4,400	7,600	7,920	10,800	14,000	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000
NM-403	TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置 (NX5000)	Hour(1h)	3,300	4,900	5,060	6,500	8,100	6,600	9,800	10,120	13,000	16,200	9,900	14,700	15,180	19,500	24,300
NM-404	無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置 (Model 1040 Nanomill)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-407	セラミックス試料作製装置群	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-501	実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)	Session(3.5h)	4,400	6,000	6,160	7,600	9,200	8,800	12,000	12,320	15,200	18,400	13,200	18,000	18,480	22,800	27,600
NM-502	実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)	Session(3.5h)	4,400	6,000	6,160	7,600	9,200	8,800	12,000	12,320	15,200	18,400	13,200	18,000	18,480	22,800	27,600
NM-503	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)	Session(3.5h)	2,200	3,800	3,960	5,400	7,000	4,400	7,600	7,920	10,800	14,000	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000
NM-504	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)	Session(3.5h)	2,200	3,800	3,960	5,400	7,000	4,400	7,600	7,920	10,800	14,000	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000
NM-505	200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)	Session(3.5h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-506	2軸傾斜バイアス印加・加熱TEM試料ホルダー (Lightning)	Session(3.5h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-507	2軸傾斜液体窒素冷却TEM試料ホルダー (Gatan 636)	Session(3.5h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-508	走査型電子顕微鏡 (JSM-7000F)	Session(3.5h)			2,860	4,300	5,900			5,720	8,600	11,800			8,580	12,900	17,700
NM-302	微細組織3次元マルチスケール解析装置 (SMF-1000)	Hour(1h)	3,300	4,900	6,500	8,100		6,600	9,800	13,000	16,200		9,900	14,700	19,500	24,300	
NM-517	FIB/SEM精密微細加工装置 (Helios 650)	Session(3.5h)	2,200	3,800	3,960	5,400	7,000	4,400	7,600	7,920	10,800	14,000	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000
NM-509	デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)	Session(3.5h)	3,300	4,900	5,060	6,500	8,100	6,600	9,800	10,120	13,000	16,200	9,900	14,700	15,180	19,500	24,300
NM-510	FIB加工装置 (JIB-4000)	Session(3.5h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-511	FIB加工装置 (JEM-9320FIB)	Session(3.5h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-512	FIB加工装置 (JEM-9310FIB)	Session(3.5h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-513	ピックアップシステム	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900	2,200	5,400	5,720	8,600	11,800	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700
NM-514	ウルトラマイクローム (Leica EM UC6)	Hour(1h)	1,100	2,700	2,860	4,300	5,900										

# NIMS解析・評価共用設備 利用料金表 (ARIM利用：データ提供なし)

税抜表示 1時間あたり (円)

設備ID	装置名	課金単位	大学・公的機関・スタートアップ企業					中小企業					大企業				
			機器利用	技術補助	技術代行1	技術代行2	技術代行3	機器利用	技術補助	技術代行1	技術代行2	技術代行3	機器利用	技術補助	技術代行1	技術代行2	技術代行3
NM-001	NMR	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-002	LC-MS(Q-Exactive Plus)	Hour(1h)	6,600	11,400	16,200			11,000	19,000	27,000			22,000	38,000	54,000		
NM-020	LC-MS(Orbitrap Exploris 480)	Hour(1h)	9,900	14,700	19,500			16,500	24,500	32,500			33,000	49,000	65,000		
NM-003	ラマン顕微鏡	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-004	共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-005	液中原子間力顕微鏡	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-006	卓上走査型電子顕微鏡装置群	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-007	表面プラズモン共鳴装置	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-008	プレートリーダー	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-009	分光光度計	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-010	分光蛍光光度計	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-011	フーリエ変換赤外分光光度計	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-012	円二色性分散計	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-013	ゼータ電位計	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-014	動的光散乱光度計	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-015	粒度分布測定装置	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-016	接触角計	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-017	テクスチャーアナライザー	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-018	HPLC(質量分析計付き)	Hour(1h)	6,600	11,400	16,200			11,000	19,000	27,000			22,000	38,000	54,000		
NM-019	ゲル浸透クロマトグラフィー装置群	Hour(1h)	3,300	8,100	12,900			5,500	13,500	21,500			11,000	27,000	43,000		
NM-101	500MHz固体汎用NMRシステム (JNM-ECZ500R)	Day(8h)	3,300	8,100	8,580	12,900		5,500	13,500	14,300	21,500		11,000	27,000	28,600	43,000	
NM-102	500MHz固体高分解能NMRシステム (JNM-ECZ500R)	Day(8h)	3,300	8,100	8,580	12,900		5,500	13,500	14,300	21,500		11,000	27,000	28,600	43,000	
NM-103	800MHzナノローボア固体高分解能NMRシステム (JNM-ECA800)	Day(8h)	3,300	8,100	8,580	12,900		5,500	13,500	14,300	21,500		11,000	27,000	28,600	43,000	
NM-201	多環境対応型X線結晶構造解析装置 (XtaLAB Synergy-R/DW Custom)	Hour(1h)	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000	11,000	19,000	19,800	27,000	35,000	22,000	38,000	39,600	54,000	70,000
NM-209	2波長Pilatus低温単結晶X線回折装置 NSC (VariMax DW AFC11 with Pilatus)	Hour(1h)	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000	11,000	19,000	19,800	27,000	35,000	22,000	38,000	39,600	54,000	70,000
NM-204	多目的X線回折装置 Cu SSL (SmartLab 9 kW)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-210	温度可変型粉末X線回折装置 Cu1 NTS (SmartLab 9 kW with cryostat/furnace)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-211	高速・高感度型粉末X線回折装置 Cu ASC NS3 (SmartLab3)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-212	卓上型粉末回折計 Cu ASC NC1 (MiniFlex600 Cu)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-213	卓上型粉末回折計 Cu ASC NC2 (MiniFlex600 Cu)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-214	卓上型粉末回折計 Cr SCR (MiniFlex600 Cr)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-215	卓上型X線回折計 Cu SMF (MiniFlex600 Cu)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-216	薄膜X線回折装置 Cu(SmartLab)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-202	硬X線光電子分光分析装置(HAX-PES/XPS) (Quantes)	Hour(1h)	6,600	11,400				11,000	19,000				22,000	38,000			
NM-225	X線光電子分光分析装置(XPS-Quantera SXM)	Hour(1h)	6,600	11,400				11,000	19,000				22,000	38,000			
NM-203	誘導結合プラズマ発光分析装置群	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-205	飛行時間型二次イオン質量分析装置 (PHI TRIFT V nanoTOF)	Hour(1h)	9,900	14,700				16,500	24,500				33,000	49,000			
NM-206	酸素窒素水素分析装置(OH836) 炭素硫黄分析装置(CS844)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-217	熱分析装置(TG/DTA+DSC) (TG/DTA 6200, X-DSC7000)	Hour(1h)	3,300	8,100				5,500	13,500				11,000	27,000			
NM-218	ゼータ電位&粒径測定装置(ELSZ-2000ZS)	Hour(1h)	3,300	8,100				5,500	13,500				11,000	27,000			
NM-219	フーリエ変換赤外分光光度計(IRAffinity-1S)	Hour(1h)	3,300	8,100				5,500	13,500				11,000	27,000			
NM-220	紫外可視近赤外分光計(V-770)	Hour(1h)	3,300	8,100				5,500	13,500				11,000	27,000			
NM-221	分光蛍光光度計(FP-8500DS)	Hour(1h)	3,300	8,100				5,500	13,500				11,000	27,000			
NM-222	蛍光分光計(Fluorolog-3)	Hour(1h)	3,300	8,100				5,500	13,500				11,000	27,000			
NM-223	フーリエ変換赤外分光計(FT/IR-6700)	Hour(1h)	3,300	8,100				5,500	13,500				11,000	27,000			
NM-224	中低温示差熱分析装置(DSC200F3)	Hour(1h)	3,300	8,100				5,500	13,500				11,000	27,000			
NM-207	電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置(JXA-8500F)	Hour(1h)	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000	11,000	19,000	19,800	27,000	35,000	22,000	38,000	39,600	54,000	70,000
NM-208	走査型オージェ電子分光分析装置 (JAMP-9500F)	Hour(1h)	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000	11,000	19,000	19,800	27,000	35,000	22,000	38,000	39,600	54,000	70,000
NM-226	ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡(JSM-7001F)	Hour(1h)	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000	11,000	19,000	19,800	27,000	35,000	22,000	38,000	39,600	54,000	70,000
NM-227	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8000)	Hour(1h)	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000	11,000	19,000	19,800	27,000	35,000	22,000	38,000	39,600	54,000	70,000
NM-403	TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置 (NX5000)	Hour(1h)	9,900	14,700	15,180	19,500	24,300	16,500	24,500	25,300	32,500	40,500	33,000	49,000	50,600	65,000	81,000
NM-404	無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置 (Model 1040 Nanomill)	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-407	セラミックス試料作製装置群	Hour(1h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-501	実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)	Session(3.5h)	13,200	18,000	18,480	22,800	27,600	22,000	30,000	30,800	38,000	46,000	44,000	60,000	61,600	76,000	92,000
NM-502	実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)	Session(3.5h)	13,200	18,000	18,480	22,800	27,600	22,000	30,000	30,800	38,000	46,000	44,000	60,000	61,600	76,000	92,000
NM-503	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)	Session(3.5h)	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000	11,000	19,000	19,800	27,000	35,000	22,000	38,000	39,600	54,000	70,000
NM-504	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)	Session(3.5h)	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000	11,000	19,000	19,800	27,000	35,000	22,000	38,000	39,600	54,000	70,000
NM-505	200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)	Session(3.5h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-506	2軸傾斜バイアス印加・加熱TEM試料ホルダー (Lightning)	Session(3.5h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-507	2軸傾斜液体窒素冷却TEM試料ホルダー (Gatan 636)	Session(3.5h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-508	走査型電子顕微鏡 (JSM-7000F)	Session(3.5h)			8,580	12,900	17,700			14,300	21,500	29,500			28,600	43,000	59,000
NM-302	微細組織3次元マルチスケール解析装置 (SMF-1000)	Hour(1h)	9,900	14,700	19,500	24,300		16,500	24,500	25,300	32,500	40,500	33,000	49,000	50,600	65,000	81,000
NM-517	FIB/SEM精密微細加工装置 (Helios 650)	Session(3.5h)	6,600	11,400	11,880	16,200	21,000	11,000	19,000	19,800	27,000	35,000	22,000	38,000	39,600	54,000	70,000
NM-509	デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)	Session(3.5h)	9,900	14,700	15,180	19,500	24,300	16,500	24,500	25,300	32,500	40,500	33,000	49,000	50,600	65,000	81,000
NM-510	FIB加工装置 (JIB-4000)	Session(3.5h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-511	FIB加工装置 (JEM-9320FIB)	Session(3.5h)	3,300	8,100	8,580	12,900	17,700	5,500	13,500	14,300	21,500	29,500	11,000	27,000	28,600	43,000	59,000
NM-512	FIB加工装置 (JEM-9310FIB)	Session(3.5h)	3,300														